🗼 Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER 09162693 **PUBLICATION DATE** 20-06-97

APPLICATION DATE 14-12-95 APPLICATION NUMBER 07325637

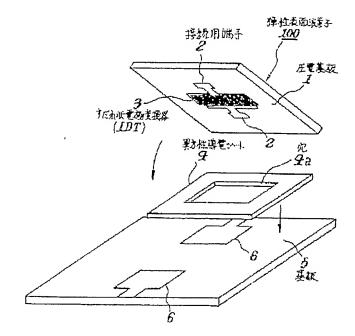
APPLICANT: KOKUSAI ELECTRIC CO LTD;

INVENTOR: ISHII AKINORI;

INT.CL. H03H 9/25 H03H 3/08

TITLE SURFACE ACOUSTIC WAVE

ELEMENT



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the surface acoustic wave element in which space formation for chip exciting electrode section, airtight sealing and connection to a substrate are conducted at once while avoiding use of large-sized components and cost increase.

> SOLUTION: An interdigital electrode transducer 3 and a connection terminal 2 are formed on a piezoelectric substrate 1 on which a surface acoustic wave element 100 is formed, an anisotropic conductive sheet 4 to a position of which corresponding to the interdigital electrode transducer 3 a hole 4a is made is inserted between the surface acoustic wave element 100 and the substrate 5 and the entire components are sealed airtightly by an epoxy resin. The continuity between the surface acoustic wave element 100 and the substrate 5 is taken by the anisotropic conductive sheet 4 by a compression stress when the epoxy resin is cured and a space 8 stimulating the surface acoustic wave is formed on the surface acoustic wave element 100.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-162693

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H03H	9/25		7259-5 J	H03H	9/25	Α	
	3/08		7259-5 J		3/08		

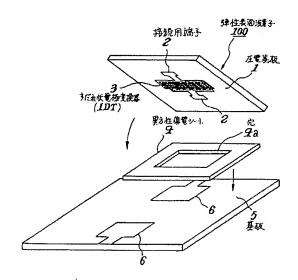
		審査請求	未請求 請求項の数1 OL (全 3 頁)		
(21)出願番号	特顧平7-325637	(71)出願人	国際電気株式会社 東京都中野区東中野三丁目14番20号 石井 昭紀		
(22)出顧日	平成7年(1995)12月14日	(72)発明者			
		(74)代理人	東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際 電気株式会社内 弁理士 石戸 元		

(54) 【発明の名称】 弾性表面波素子

(57)【要約】

【課題】 部品の大型化、コスト増をおさえ、チップの 励振電極部の空間形成、気密封止、基板との接続を一挙 に行なえる弾性表面波素子を提供する。

【解決手段】 形成された弾性表面波素子100の圧電基板1上には、すだれ状電極変換器3と接続用端子2とを形成し、このすだれ状電極変換器3に対応する部分に穴4aを開けた異方性導電シート4を弾性表面波素子100と基板5との間にはさみ、全体をエポキシ樹脂で気密に封止し、このエポキシ樹脂が硬化するときの圧縮応力で弾性表面波素子100と基板5との導通を異方性導電シート4で取り、かつ弾性表面波素子100上に弾性表面波が励振可能な空間8を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 形成された弾性表面波素子の圧電基板上 には、すだれ状電極変換器と接続用端子とを形成し、と のすだれ状電極変換器に対応する部分に穴を開けた異方 性導電シートを弾性表面波素子と基板との間にはさみ、 全体をエポキシ樹脂で気密に封止し、このエポキシ樹脂 が硬化するときの圧縮応力で弾性表面波素子と基板との 導通を異方性導電シートで取り、かつ弾性表面波素子上 に弾性表面波が励振可能な空間を形成したことを特徴と する弾性表面波素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電極部分に弾性表 面波が励振および伝搬可能な空間を形成し、かつ基板と の接続を取るように気密封止する弾性表面波素子に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】弾性表面波素子(共振子、フィルタ等) を他のIC回路等と同時に封止すると、樹脂が励振する 電極表面に触れるため所望の電気特性を満足することは 20 本来は圧電基板 1 の 1 / 3 0 0 以下の厚みである。 できない。図4は従来の弾性表面波素子の接続方法を示 すもので、10は弾性表面波素子の圧電基板、11はボ ンディングワイヤ、12はセラミック等のパッケージ、 13はパッケージ側電極、14は金属カバーで、圧電基 板10の励振する電極面10aを中空かつ気密にするた め、セラミック等のパッケージ12を用いて金属カバー 14の溶接により封止している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図4に示した ように、弾性表面波素子1チップを1パッケージに入れ 30 【0008】 るため、パッケージの大きさにより部品の大きさが決定 され、またパッケージ12はワイヤ11のボンドと金属 カバー14とが接触しないように十分な厚さが必要であ り、部品の小型化、薄型化にも制約があった。また、セ ラミック等のパッケージ12は髙価なためにコスト増に なってしまう。したがって、従来の方法では部品の小型 化、低価格化に限度があった。本発明の目的は、かかる 従来技術の問題点であるパッケージの使用に伴う部品の 大型化、コスト増をおさえるもので、チップの励振電極 部の空間形成、気密封止、基板との接続を一挙に行なえ 40 る弾性表面波素子を提供するものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の課題に鑑 みなされたものであって、形成された弾性表面波素子 1 00の圧電基板1上には、すだれ状電極変換器3と接続 用端子2とを形成し、このすだれ状電極変換器3に対応 する部分に穴4 a を開けた異方性導電シート4を弾性表 面波素子100と基板5との間にはさみ、全体をエポキ シ樹脂で気密に封止し、このエポキシ樹脂が硬化すると きの圧縮応力で弾性表面波素子100と基板5との導通 50 3

を異方性導電シート4で取り、かつ弾性表面波素子10 0上に弾性表面波が励振可能な空間8を形成したことを 特徴とする。

[0005]

【発明の実施の形態】図1示のように、弾性表面波素子 100の圧電基板1上に接続用端子2, すだれ状電極変 換器(Inter Digital Transducer,以下IDTと略記す る) 3で構成し、との弾性表面波素子100とガラス、 エポキシ、セラミック等の基板5との間に異方性導電シ 10 - ト4をはさむ。この時、弾性表面波素子 100の ID T3に対応する部分に穴4 aを開けておく。この穴4 a はIDT3の面積より大きく、接続用端子2と基板側接 続用端子6が接続できれば、いかなる形状、大きさでも

【0006】図2(a)は、弾性表面波素子100と異 方性導電シート4と基板5とを重ねた状態である。図2 (b) は図2(a) のA-A線断面図である。 との断面 図において、接続用端子2, 1DT3, 基板側接続用端 子6は、図面を判りやすくするために厚く表現したが、

【0007】図3は図2のものをエポキシ樹脂7で封止 した状態の断面図である。エポキシ樹脂7が硬化する時 に圧縮応力が動き、異方性導電シート4を介して接続用 端子2と基板側接続用端子6が接続される。さらに、1 DT3と基板5との間には弾性表面波素子100上に弾 性表面波が励振可能な空間8を形成し、全体は気密に封 止される。以上のようにして、この装置は弾性表面波が 励振可能な空間を持たせ、かつ気密に封止した弾性表面 波素子となる。

【発明の効果】以上のように本発明によれば、セラミッ ク等のバッケージを使用することなく電極励振部の空間 形成、気密封止、基板との接続を一度に行うことができ る。それにより、工程数の削減による大幅なコスト削減 が可能である。さらに、パッケージを使用する必要がな いので、原価低減、素子の小型化が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態の重ね合わせ前の状態の斜

【図2】(a)は本発明の一実施形態の重ね合わせ後の 状態の斜視図、(b)は(a)のA-A線断面図であ

【図3】本発明の一実施形態のエポキシ樹脂封止後の状 態の断面図である。

【図4】従来の装置におけるセラミックパッケージの構 成の断面図である。

【符号の説明】

- 圧電基板
- 2 接続用端子
- すだれ状電極変換器 (IDT)

3

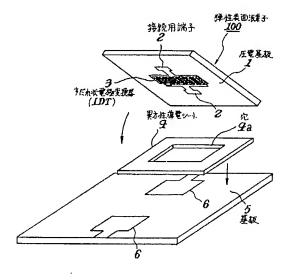
- 4 異方性導電シート
- 5 基板
- 6 基板側接続用端子

*7 エポキシ樹脂

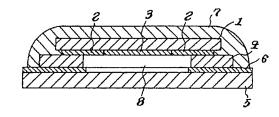
8 空間

* 100 弹性表面波素子

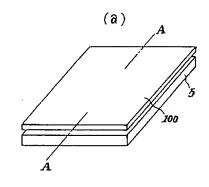
【図1】

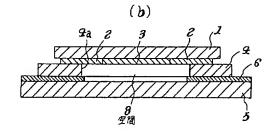


【図3】

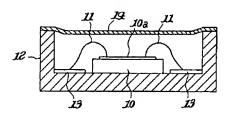


【図2】





【図4】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第3区分

[発行日] 平成14年6月28日(2002.6.28)

【公開番号】特開平9-162693

【公開日】平成9年6月20日(1997.6.20)

【年通号数】公開特許公報9-1627

[出願番号]特願平7-325637

【国際特許分類第7版】

H03H 9/25

3/08

[FI]

H03H 9/25 A

3/08

【手続補正書】

[提出日] 平成14年3月28日(2002.3.2 8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正内容】

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図4に示したように、弾性表面波素子1チップを1パッケージに入れるため、パッケージの大きさにより部品の大きさが決定

され、またパッケージ12は<u>ボンディング</u>ワイヤ11の ボンドと金属カバー14とが接触しないように十分な厚 さが必要であり、部品の小型化、薄型化にも制約があっ た。また、セラミック等のパッケージ12は高価なため にコスト増になってしまう。したがって、従来の方法で は部品の小型化、低価格化に限度があった。本発明の目 的は、かかる従来技術の問題点であるパッケージの使用 に伴う部品の大型化、コスト増をおさえるもので、チップの励振電極部の空間形成、気密封止、基板との接続を 一挙に行なえる弾性表面波案子を提供するものである。